









管理No: O60881 SH-450 製造番号: MH94-5082

1. 到達真空度  
到達真空:  $3.3\text{E}-7\text{Torr}$  良好



2. 基板回転動作良好  
動画有り
3. シャッター開閉確認良好  
動画有り
4. MFCコントローラ動作確認良好  
各MFCのMAX、MIDの流量にて設定値と  
実際の流量を確認実施

	流量設定 MAX	MID
Ar	 設定200sccm	 設定100sccm
N2	 設定50sccm	 設定25sccm
H2	 設定30sccm	 設定15sccm
O2	 設定10sccm	 設定5sccm

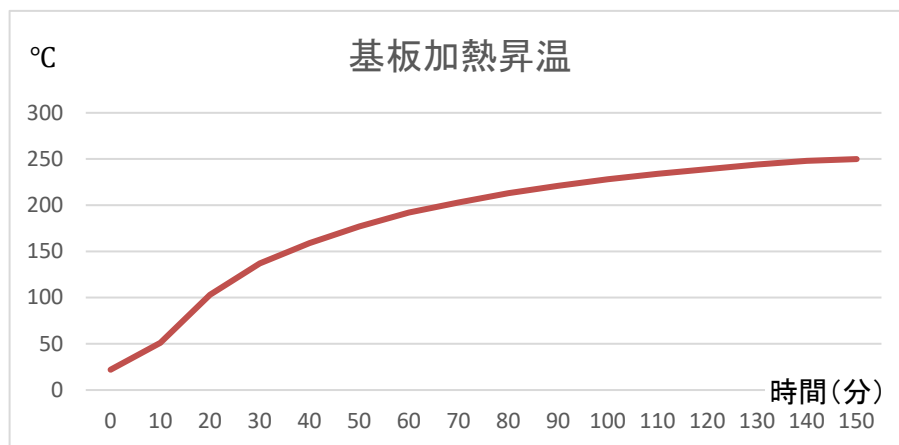
※H2ガスが弊社に無い為N2ガスにて確認実施

5. ルーツポンプ動作確認良好
6. TMP動作確認良好  
ROTATION: 100% 確認異音無

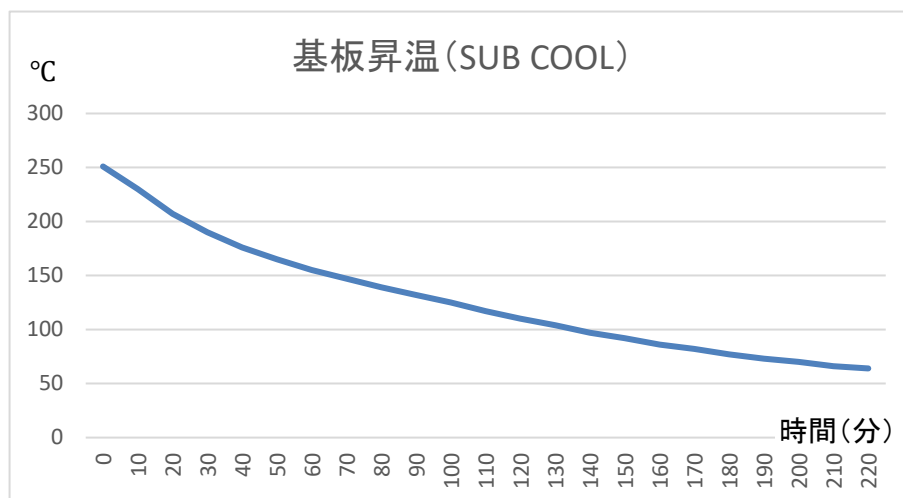
7. CHAMB BAKE昇温確認良好  
※基盤ヒーター用TCにて温度上昇を確認



8. 基板加熱昇温確認良好  
設定値250°C(装置上限)  
昇温時間: 150分  
電流値: 7A設定



9. SUB COOL動作確認良好  
設定値250°C(装置上限)  
降温時間: 220分



※251°C: AIR-ON    147°C: MIST-ON    97°C: WATER-ON  
上記温度にて操作切り替え実施

# 10.放電確認良好

放電確認良好(3元処理動画撮影有り)

※LOCAL運転にて放電確認実施(オート処理なし)

SPUTTER TIME設定時間終了後シャッターCLOSE、DC、RFすべてOFFにて終了確認済み



Ar70sccm



圧力0.18Pa



処理終了はOUTの表示にて確認

	Pf(W)	Pr(W)
ET	142W	0.00W



	VOLTAGE(V)	POWRW(kw)
DC1	503	2.15
DC2	502	3.19



CA1



CA2

	Pf(kw)	Pr(W)
ET	1.5	0



CA3



処理前



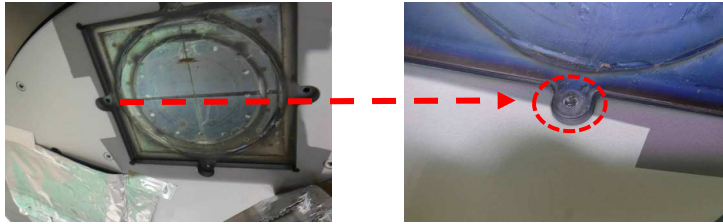
処理後

カプトンテープにスパッタリングしたのを確認

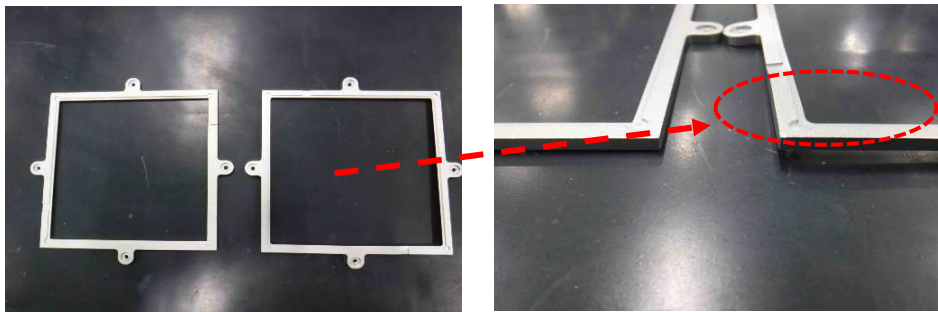
ホルダー固定部分にアルミ箔をカプトンテープにて取り付けて確認実施

## 不具合箇所

1. 基板ホルダー固定ネジ折れ有り  
※基盤5セット中4/5(各1か所)



2. 基板ホルダー変形有り1/5(固定は可能)  
※基盤5セット中4/5(1個)



3. SPUTTER TIMER設定不可(3/3)  
ボタンSW裏面にアルミテープを取り付けて使用  
ボタンスイッチ正業動作確認OK(3/3)  
※製造終了品中古品にて交換が必要です

